# 测量单模波导参数的新方法: 导模和漏模的双偏振测量

## 会锋 李丽娜

(中国科学院长春物理所)

#### 捉 丢

本文提出测量单模波导参数的新方法。用棱镜耦合器测量两种偏振基导模和基漏模的模折射率,并 由相应的四个模方程确定单模波导参数。其测量精度优于纯导模测量。用这种方法测量了单模玻璃波导 参数,并对误差来页作了理论分析。 关键词: 棱镜耦合器,单模波导参数,导模和漏模。

## 一、引 言

**集成光路一般由单模波导器件组成,由此,用棱镜耦合器准确测量单模波导参数(薄膜的**折射率和厚度),是集成光学中的重要测试课题之一。

对此,我们曾在文献[1]中概述了已有三种测量方法,并又提出了一种精度较高的双偏 振测量方法。前者由一种偏振基导模的模方程确定单模波导参数,后者由两种偏振其导模 的模方程确定单模波导参数。这四种方法均只涉及导模,均对应于单模波导参数的一次独 立测量。

为了进一步提高测量精度,本文提出一种用棱镜耦合器测量两种偏振基导模和基漏模 的模折射率,并由相应的四个模方程确定单模波导参数。这种测量相当于单模波导参数的 三次独立测量,其测量精度优于前述四种方法。文中用该法测量了单模玻璃波导参数,并对 误差来源作了理论分析。

## 二、波导和漏波导

图 1 表示棱镜-薄膜耦合器。其中  $n_3$ 、 $n_2$ 、 $n_1$ 和  $n_0$ 分别为棱镜、耦合隙、薄膜和衬底的折 射率, b 和 d 分别为耦合隙和薄膜的厚度,  $\theta_i$ 为 i 介质中波矢量与界面法线的 夹 角。对于 导模测量, 耦合隙是空气, 且  $n_3 > n_1 > n_0 > n_0 = 1$ ; 对于漏模测量, 耦合隙中滴入匹配液, 且  $n_8 \approx n_2 > n_1 > n_0$ 。

三层介质 no、 n₁ 和 n₂, 当 b→∞ 时构成平板波导; 而当 n₂→n₃ 时, 构成平板漏波导, 分别示于图 2(a)和(b)。图 2表示了考虑到 Goos-Hänchen 位移的导模和漏模的 锯齿 波模型<sup>[20]</sup>。导模在 0-1 和 1-2 界面上全反射, 光能量集中在薄膜中传播; 漏模在 0-1 界面上

收稿日期: 1987年12月14日; 收到修改稿日期: 1988年3月23日

全反射, 而在 1-2 界面上折反射, 光能量泄漏到半无限空间中, 图中的 2d, 和 z, 分别为光波 在薄膜中往返一次的横向和纵向传播距离。

则光波在薄膜中往返一次的横向相移为。30

 $\psi^0 = 2K_1 d - 2\phi_{10} - 2\phi_{13}$ , (1) 橫向共振条件下, $\psi^0 = 2m\pi$  (m = 0, 1, 2,...),得出导模或共振漏模(本文简称漏模) 的模方程<sup>20</sup>











 $K_{1}d = mx + \phi_{10} + \phi_{12},$   $\phi_{ij} = \begin{cases} \tan^{-1} (n_{i}/n_{j})^{a_{j}} (p_{i}/K_{i}), & \pm \nabla \Re \\ (\pi/2), & (r_{ij} < 0), & \text{ff} \nabla \Re \end{cases}$   $K_{i} = n_{i}k \cos \theta_{i} = (n_{i}^{2} - N^{2})^{1/2}k, \quad p_{i} = (N^{2} - n_{j}^{2})^{1/2}k,$   $N = n_{i} \sin \theta_{i} = n_{1} \sin \theta_{1}, \quad k = (2\pi/\lambda),$ (2)

式中-2 $\phi_{ij}$ 为 $\hat{\bullet}$ ·*j*界面上的反射相移,  $K_i$ 为i介质中的横向传播常数,  $p_i$ 为j介质中的横 向衰减常数, N 为横折射率, m 为模阶数,  $\rho=0$ 和1分别对应于TE模和TM 模, k和  $\lambda$ 分别为真空中的波数和波长,  $r_{ij}$ 为 $\hat{\bullet}$ -*j*界面上的反射系数, 由(2)式, 得到基导模和其漏模 的模方程分别为

$$(n_1^2 - N^2)^{1/2} k d = \tan^{-1} \left(\frac{n_1}{n_0}\right)^{3\rho} \left(\frac{N^3 - n_0^2}{n_1^2 - N^3}\right)^{1/2} + \tan^{-1} n_1^{2\rho} \left(\frac{N^3 - 1}{n_1^2 - N^2}\right)^{1/2}, \tag{3}$$

$$(n_1^2 - N^2)^{1/2} k d = \tan^{-1} \left( \frac{n_1}{n_0} \right)^{2\rho} \left( \frac{N^2 - n_0^2}{n_1^2 - N^2} \right)^{1/2} + \frac{\pi}{2} o$$
(4)

用这四个模方程可以确定单模波导参数。

利用截止条件 N-nok,由(2)式,可推得薄膜同时维持单一 TE、TM 导模和单-- TE、 TM 漏模的条件为

$$0.5 < [2(n_1^2 - n_0^2)^{1/2}(d/\lambda)] < \left[1 + (1/\pi) \tan^{-1} \left(\frac{n_0^2 - 1}{n_1^2 - n_0^2}\right)^{1/2}\right]_{\circ}$$
 (5)

文中单模波导就指满足(5)式的薄膜波导,

dy 可写成<sup>in</sup>

$$d_{j} = \begin{cases} d + (1/\xi_{0}p_{0}) + (1/\xi_{2}p_{0}), \forall k \\ d + (1/\xi_{0}p_{0}), & k \\ \xi_{i} = (N/n_{i})^{2} + (N/n_{1})^{2} - 1, (\phi = 0, 2) \end{cases}$$
(6)

由(1)式,可以证明

$$\mathbf{z}_{t}\mathbf{k} = 2d_{t}\mathbf{k}\tan\theta_{1} = -\left(\frac{\partial\psi^{0}}{\partial N}\right),\tag{7}$$

# 三、单模玻璃波导测量

待测的单模波导样品是在 Ko 玻璃衬底(no=1.51639)上溅射 BaK7 玻璃薄膜而成的。测



Fig. 3 The measuring apparatus

量用的对称棱镜由 ZF<sub>6</sub> 玻璃博展而成的。两 量用的对称棱镜由 ZF<sub>6</sub> 玻璃( $n_3 = 1.75132$ ) 制成,棱镜角为  $\epsilon = 45^{\circ}35'48''$ 。 光源采用  $\lambda = 0.6328$  和孔径 1mm 的平行氦氖激光 束。

测量装置如图 3 所示。将对称棱镜放 在波导样品表面, 经夹住后一并置于最小 刻度为 30" 的测角仪转盘中心。调整样品 位置, 使激光束入射到棱镜底中心, 先在耦 合院为空气时, 改变激光束对棱镜斜面的

入射角 a, 在观察屏上出现 m 线时, 读出基导模的同步入射角。 然后在其他测量条件不变时, 耦合隙中滴入二碘甲烷(n,=1.7425), 改变 a 并出现 m 线时, 读出基漏模的同步入射角,模折射率的测量值 N<sub>24</sub> 可写成<sup>65</sup>

$$N_{\mu\mu} = \sin \alpha_{\mu\mu} \cos \epsilon + (n_3^2 + \sin^2 d_{\mu\mu})^{1/2} \sin \epsilon \tag{8}$$

式中 α<sub>ν</sub> 为同步入射角, 下标 ν 表示 TE 模或 TM 模, 下标 μ 表示基导模或基漏模, 对每个 模折射率, 我们都作了七次测量。

设一误差和57为

$$\sigma = \sum_{\nu,\mu} [\vec{N}_{\nu\mu} - N_{\nu\mu}(n_1, d)]^2, \qquad (9)$$

式中 N<sub>vu</sub> 为模折射率的理论值,对给定的 ma 和 d 由模方程(3)和(4)求得。改变 ma 和 d, 使 σ 取最小值 σ<sub>min</sub>。将与 σ<sub>min</sub> 相对应的 ma 和 d 分别记作 ma 和 d, 这就是单模波导参数的 测 量值。其均方误差可表示为

$$\Delta m_{1} = \left[ \sum_{\nu \mu} |\Delta m_{1}(\nu, \mu)|^{2}/6 \right]^{1/2}, 
\Delta d = \left[ \sum_{\nu \mu} |\Delta d(\nu, \mu)|^{2}/6 \right]^{1/2},$$
(10)

$$\begin{aligned}
\Delta n_{1}(\nu, \mu) &= [\bar{N}_{\nu\mu} - N_{\nu\mu}(\bar{n}_{1}, d)] \frac{2\Delta_{n}}{N_{\nu\mu}(\bar{n}_{1} + \Delta_{n}, \bar{d}) - N_{\nu\mu}(\bar{n}_{1} - \Delta_{n}, \bar{d})}, \\
\Delta d(\nu, \mu) &= [\bar{N}_{\nu\mu} - N_{\nu\mu}(\bar{n}_{1}, d)] \frac{2\Delta_{d}}{N_{\nu\mu}(\bar{n}_{1}, \bar{d} + \Delta_{d}) - N_{\nu\mu}(\bar{n}_{1}, \bar{d} - \Delta_{d})},
\end{aligned}$$
(11)

式中4.和4.分别为 m 和 d 的计算步长,实际采用了4,=10-\*和 k4,=10-\*。

单模玻璃波导参数的测量结果如表1所示。由表1可知,薄膜折射率和薄膜厚度的相 对测量误差分别为0.8×10<sup>-4</sup>和0.7×10<sup>-9</sup>。显然,这种方法的测量精度优于纯导模的双偏 振测量<sup>113</sup>。此外,把测得的波导参数代入 m=1阶模的截止方程后可知, m=1阶模未截止, 并不满足单模波导的条件(5)式。但是, m=1阶模接近截止,故在实验中只观察到基模,而 未能观察到 m=1阶模。

8 卷

mode	$\overline{N}_{\nu\mu}$	N <sub>vµ</sub> (\$1, d)	$\overline{N}_{\nu\mu} - N_{\nu\mu}$	$N_{\nu\mu} - N_{\nu\mu}$	$\overline{n}_1 \pm \Delta n_1$	d±∆d
TE <sub>0</sub> guided mode	1.54124	1.54122	0.2×10-4			
TMo gaided mode	1.54041	1.54054	-1.3×10-4		1.55094	1.427
TE <sub>0</sub> leaky mode	1.54050	1.54026	2.4×10-4	1.2×10-4	±1.3×10-4	±1.0×10-2 (µm)
TM <sub>0</sub> leaky mode	1.53998	1.54011	$-1.3 \times 10^{-4}$			

Table 1 Measuring values for parameters of the single mode glass waveguide

## 四、误差来源分析

将耦合器中的薄膜看作一个干涉仪<sup>43</sup>,用多光束干涉原理<sup>43</sup>,推得在平衡状态下薄膜和 棱镜中的光能量密度之比。

$$\frac{w_{1}}{w_{s}} = \left(\frac{1+r}{1-r}\right) \left[1 + \frac{4r}{(1-r)^{3}} \sin^{2}\left(\frac{\psi}{2}\right)\right]^{-1}, \qquad (12)$$

$$\psi = 2K_{1}d - 2\phi_{10} - 2\phi_{133},$$

式中 4 是光波在耦合器的薄膜中往返一次的横向相移, r 和 - 2 4128 分别为在三层介质 (n1、 na 和 na)1-2 界面上的反射系数 r128 绝对值和反射相移。r128 的表达式为<sup>(5)</sup>

$$r_{123} = \frac{r_{12} + r_{23} \exp(i 2K_{2}b)}{1 + r_{12}r_{33} \exp(i 2K_{2}b)} = r \exp(-i 2\phi_{133}),$$

$$r_{4} = \frac{Km_{1}^{2} - Km_{1}^{2}}{Km_{1}^{2} + Km_{1}^{2}},$$
(13)

式中 ru 对于导模测量,在(13)式中应作如下代换

 $r_{13} = \exp(-i2\phi_{13}), r_{23} = -\exp(-i2\phi_{33}), \exp(i2K_{2}b) = \exp(-2\rho_{2}b), \quad (14)$ 

由(12)式可知,  $(w_1/w_8)$ 在耦合器的共振点( $\psi = 2m\pi$ )取极大值,相应地在观察屏上出 現 m 线。要测的模折射率,就是这一共振点的模折射率。然而对于漏模测量,由(12)、(13) 式可知,  $(w_1/w_8)$ 在  $2K_{sb} = n\pi$  或(2n+1)  $(\pi/2)$   $(n=0, 1, 2, \cdots$ )时也能取极值,并在观察屏 上有可能出现假 m 线。若适当选择  $n_3 \approx n_8$ ,降低光波在耦合隙中的共振效应。便可去掉假 m 线。为了说明这一点,选择  $n_3 = 1.58$  和  $n_2 = 1.7425$ ,用测得的波导参数,由(12)式和(13) 式计算出漏模的  $(w_1/w_8) \sim N$  共振曲线,其结果分别示于图 4(a)和(b),由图 4 可见,当  $n_2 = 1.58$  和  $n_8 = 1.75132$  相差较大时,出现两个共振峰,其中一个峰对应于 假 m 线;当  $n_9 = 1.7425$  和  $n_8 = 1.75132$  相差不多时,只出现一个共振峰,对应于真 m 线。

实测的模折射率只能是在共振峰上耦合器共振点  $\psi = 2m\omega$  附近的模折射率,而不是波导或漏波导共振点  $\psi^2 = 2m\omega$  的模折射率。所以,除了测试系统所带来的误差以外,模折射率的测量误差还有两个来源:一是共振峰的半能量模折射率宽度  $4N_{\lambda}$ ,二是  $\psi = 2m\omega$  和  $\psi^2 = 2m\omega$  之间的模折射率之差  $4N_{\alpha}$ 。由(1)、(7)和(12)式,推得

报

8 卷





$$\frac{dN_{k} = 2\sin^{-1}[(1-r)/2\sqrt{r}]/z_{1}k}{dN_{d} = -2(\phi_{122} - \phi_{12})/z_{1}k_{0}}$$
(15)

要减少 4N,和 4N<sub>e</sub>,必须把棱镜对波导或漏波导的影响降低到测量精度 所允许的程度。这种影响可由 4r = r<sub>133</sub> - r<sub>1</sub>, 来表示,由(13)式可知, |4r|很小的条件是

$$|(r_{23}/r_{12})\exp(i2K_{2}b)| \ll 1_{\circ}$$
 (16)

在此条件下,(13)式可近似写成

 $r_{123} \approx r_{12} \left[ 1 + (1 - r_{12}^2) \left( r_{23} / r_{12} \right) \exp \left( i 2K_2 b \right)_o \right]$ (17)

对于给定的棱镜和波导样品。由(16)式可知,漏模测量应选用折射率接近等于棱镜折射率 的匹配液;在(16)式中经代换(14)式后可知,导模测量应选用较大的耦合隙。

在实际测量中,漏模测量难以选择 ng = ng 的匹配液,而导模测量不能采用太大的耦合 隙。因此,上述两种误差总是存在的。为了对此作定量计算,对于漏模测量,由(17)和(15) 式推得

$$r = |r_{13}| [1 + (1 - r_{12}^2) (r_{23}/r_{13}) \cos 2K_3 b],$$
  

$$\phi_{133} = (\pi/2) - (1/2) (1 - r_{12}^2) (r_{23}/r_{13}) \sin 2K_3 b,$$
  

$$\Delta N_4 = (1 - r_{12}^2) (r_{33}/r_{13}) \sin 2K_3 b/z_1 k_2$$
(18)

对于导模测量,由(17)、(15)和(14)式推得

$$r = 1 - 2 \exp(-2p_{2}b) \sin 2\phi_{12} \sin 2\phi_{33},$$
  

$$\phi_{123} = \phi_{12} + \exp(-2p_{2}b) \sin 2\phi_{12} \cos 2\phi_{33},$$
  

$$\Delta N_{4} = -2 \exp(-2p_{2}b) \sin 2\phi_{12} \cos 2\phi_{33}/z_{1}k_{o}$$
(19)

根据模折射率测量精度的具体要求,对于漏模测量和导模测量,分别用(18)和(19)式,可选择适当的匹配液和耦合隙。

对于实验的波导样品和棱镜,用测得的波导参数和上述有关公式,计算出 $r_{\Lambda}4N_{\Lambda}$ 和  $\Delta N_{d}$ ,如表 2 所示。由表 2 可见,对于导模测量,只要调节耦合隙达到 $(b/\lambda) \ge 0.2$ ,  $\Delta N_{\Lambda}$ 和  $\Delta N_a$ 的数量级均小于 10<sup>-4</sup>,故不影响表 1 所示波导参数的测量精度。对于漏模测量,不管 耦合隙多大,  $\Delta N_a$ 的数量级为 10<sup>-3</sup>,而  $\Delta N_a$ 的数量级为 10<sup>-5</sup> 以下,显然,其  $\Delta N_a$  值不影响 表 1 所列的测量精度,至于其  $\Delta N_a$ 值,由于跟睛的灵敏度约为 27 db,并经过多次测量,将其 影响可减少到如表 1 所示的测量精度所要求的程度。

polarized	Ъ/л	guided mode measured $(n_1 = 1.0000)$			Leaky mode measured $(n_2=1.7425)$		
		τ	ANA	$\Delta N_d$	r	$\Delta N_h$	$\Delta N_d$
TE mode	0.1	0.9375	$2.3 \times 10^{-4}$	$1.6 \times 10^{-4}$	0.6288	1.5×10-8	$-3.0 \times 10^{-5}$
	0.2	0.9857	5.2×10 <sup>-5</sup>	3.6×10 <sup>-5</sup>	0.6322	1.6×10-8	$-3.2 \times 10^{-5}$
	0.3	0.9967	1.2×10-5	8.3×10-6	0.6286	1.6×10-3	$-2.5 \times 10^{-6}$
	0.4	0,9992	2.7×10-6	1.9×10-6	0.6314	1.6×10-3	2.9×10 <sup>-5</sup>
	0.5	0,9998	6.2×10-7	4.3×10-4	0.6380	$1.5 \times 10^{-3}$	3.3×10-5

Table 2 Calculation values of r,  $\Delta N_{A}$  and  $\Delta N_{d}$ 

综上所述,导模和漏模双偏振测量的联用可提高单模波导参数的测量精度。它不仅对 于集成光学中单模波导参数测量有着十分重要的意义,而且在薄膜工艺中为测量非常薄的 光学薄膜参数提共了一种新的测试手段,此外,该法也可用来确定渐变折射率单模波导的参数。

#### 参考文献

[1] 金 锋,李玉善; 《光学学报》, 1981, 1, No. 4 (Jul), 351~356。

[2] 金锋,范俊清;《集成光学》,上册,国防工业出版社(1981年),§1.2。

[3] R. Ulrich, R. Torge; Appl. Opt., 1973, 12, No. 12 (Dec), 2901~2908.

[4] P. K. Tien, R. Ulrich; J. O. S. A., 1970, CO, No. 10 (Oct), 1325~1337.

[5] M. 玻恩, E. 沃耳夫; 《光学原理》, 上册, 科学出版社(1978年), §1.5, §1.6, §7.6。

. ·

## A new method for measuring single-mode waveguide parameters: Two polarization measurements of guided and leaky modes

JIN FENG AND LI LINA (Changehum Institute of Physics, Academia Sinica) (Received 14 December 1987; revised 23 March 1988)

### Abstract

A new method for measuring single-mode waveguide parameters is presented in this paper. Mode refractive indices of fundamental guided and leaky modes at two polarization states are measured by the prism coupler, and single-mode waveguide parameters are determined from four corresponding mode equations. Its measuring accuracy is higher than that of measurements of pure guided modes. Single-mode glass waveguide parameters were measured by this method, and its error sources were analysed theoretically.

Key words: prism coupler; single-mode waveguide parameters; guided and leaky mode.